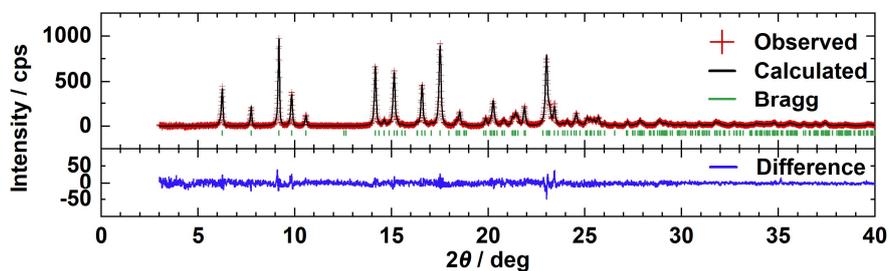


全自動多目的 X 線回折装置

製造元	株式会社リガク
仕様	全自動多目的 X 線回折装置 SmartLab・40 kV, 50 mA
保有部署	高分子化学専攻・田中一生研究室
設置場所	桂・A2 棟・B1 階インキュベーション・コアラボ)
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/
注意事項等	利用前に本学所定の X 線等装置取扱のための業務従事登録が必要となります。
連絡先	高分子化学専攻田中一生研究室 助教 伊藤峻一郎 (直通) 075-383-2608 ito@poly.synchem.kyoto-u.ac.jp
キーワード	粉末 X 線回折、薄膜 X 線、粉末未知構造解析、Rietveld 法
機器コード	0000115012
自由記入欄	インターロック機構が搭載されており、X 線管理区域は装置内部または入射ユニット内に限定されています。試料は水平に保たれるため設置が容易です。Bragg-Brentano 光学系の他、薄膜法やキャピラリでの測定に対応し、有機・無機・高分子など、さまざまな試料の X 線構造解析が可能です。



装置外観



粉末 X 線回折測定データの例